МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2022/2023 навчальний рік, прийому студентів 2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

_____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"___" _____ 2022 р.

Спеціальність	132 Матеріалознавство	Факультет/ННІ	Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
Освітня програма	Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів	Форма навчання	*Очна*
Освітній ступінь	бакалавра	Термін навчання	3 роки 10 місяців
Випускова кафедра	*Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ*	Кваліфікація	Бакалавр з матеріалознавства

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години								СРС	Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами							
																								1 курс							
																								ІМЗ-21М (Б: 20, К: 5);							
								Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор												1 семестр				2 семестр			
																								18 тижнів				18 тижнів			
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	Інд. зан.		Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	Всього	у т.ч. Лекц	Практ	Лаб	Всього	у т.ч. Лекц	Практ	Лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																															
Цикл загальної підготовки																															
1	*Українська мова за професійним спрямуванням*	УМЛК	20	5	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24		2	2										2	1	1	
2	*Історія науки і техніки*	КІ	20	5	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24		1	1						2	1	1					
3	*Основи здорового способу життя*	ТОС	20	5	3	90	72	18	-	54	-	-	-	0	18		2	1,2						2	1	1		2		2	
4	*Практичний курс іноземної мови. Частина 1*	АМТС2	20	5	3	90	72	-	-	72	-	-	-	0	18		2	1						2		2		2		2	
5	*Вища математика. Частина 1. Диференційне числення та лінійна алгебра*	МФДР	20	5	8.5	255	144	72	-	72	-	-	-	0	111	1		1			1			8	4	4					
6	*Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення та диференційні рівняння*	МФДР	20	5	6.0	180	108	54	-	54	-	-	-	0	72	2		2			2							6	3	3	
7	*Інформатика, обчислювальна техніка та числові методи. Частина 1. Інформатика, обчислювальна техніка та програмування*	ВМПМ	20	5	6.0	180	90	18	-	-	-	72	-	0	90	1		1			1			5	1		4				
8	*Інформатика, обчислювальна техніка та числові методи. Частина 2. Числові методи*	ВМПМ	20	5	3.5	105	72	36	-	-	-	36	-	0	33		2	2			2							4	2		2
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					34	1020	630	234	0	288	0	108	0	0	390	3	5	9	0	0	4	0	0	19	7	8	4	16	6	8	2
Цикл професійної підготовки																															
9	*Хімія. Частина 1. Загальна хімія*	ЗНХ	20	5	5.5	165	90	36	-	18	-	36	-	0	75	1		1						5	2	1	2				
10	*Хімія. Частина 2. Хімія елементів*	ЗНХ	20	5	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	2		2										4	2		2
11	*Інженерна та комп'ютерна графіка. Частина 1. Інженерна графіка*	НГІКГ	20	5	3.0	90	54	18	-	36	-	-	-	0	36		1	1						3	1	2					
12	*Інженерна та комп'ютерна графіка. Частина 2. Комп'ютерна графіка*	НГІКГ	20	5	2.5	75	54	-	-	54	-	-	-	0	21		2	2										3		3	
13	*Інженерна та комп'ютерна графіка. Курсова робота*	НГІКГ	20	5	1.0	30	0	-	-	-	-	-	-	0	30		2		2												
14	*Фізика. Частина 1. Механіка, теплові явища, магнетизм*	МФП	20	5	7.0	210	126	72	-	36	-	18	-	0	84	2		2			2							7	4	2	1
15	*Вступ до матеріалознавства*	ВМПМ	20	5	2.0	60	36	36	-	-	-	-	-	0	24		1	1				1		2	2						
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					26	780	432	198	0	144	0	90	0	0	348	3	4	6	1	0	1	1	0	10	5	3	2	14	6	5	3
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					60	1800	1062	432	0	432	0	198	0	0	738	6	9	15	1	0	5	1	0	29	12	11	6	30	12	13	5
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																															
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					60	1800	1062	432	0	432	0	198	0	0	738	6	9	15	1	0	5	1	0	29	12	11	6	30	12	13	5

Військова підготовка у 5 - 8 семестрах за окремим планом військової підготовки																															